



高分解能FiDiCa[®]

二次元膜厚分布測定装置により高分解能による局所測定および6インチサイズまでの全面測定を行います。

装置の特徴

● 高分解能による局所測定

6 μ mの高分解能で約3mm角を測定できるため、局所的な測定が求められるデバイスパターン上などの膜厚分布測定に向いています。

● 6インチサイズまでの全面測定

測定点間隔のメッシュサイズを選択でき、6インチウエハサイズまで全面測定できます。

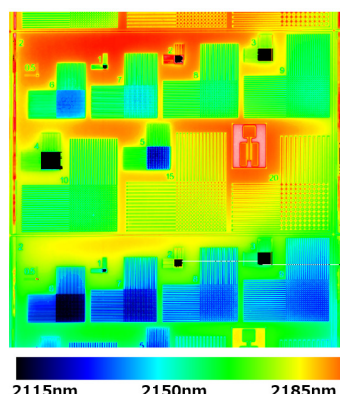
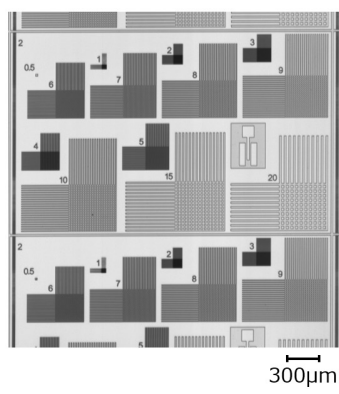
装置仕様

| 項目 | 仕様 |
|--------------------|--|
| ハイパースペクトルカメラ分光波長範囲 | 450-750nm |
| 測定膜厚範囲 | 100 - 30,000nm (測定対象による) |
| 測定サイズ | 局所測定: 2.84mm角 全面測定: 約150mm角 |
| 測定点数 | 局所測定: 484 \times 484点 全面測定: 装置設定による |
| 空間分解能 | 局所測定: 5.86 μ m |
| 測定速度 | 局所測定: 約30秒 全面測定: 装置設定による |
| 繰り返し再現性 | 3 σ <1nm (校正されたSiウエハ上の1 μ m厚SiO ₂ 膜測定時) |
| 光源 | 白色LED (波長: 450 - 750nm) |
| 装置サイズ | W:510 \times D:620 \times H:280 |

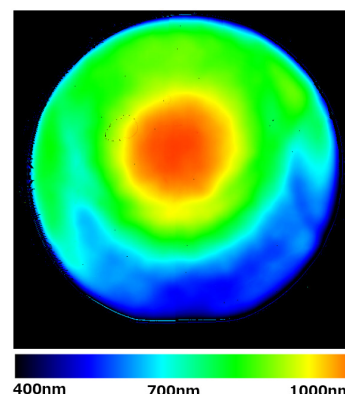
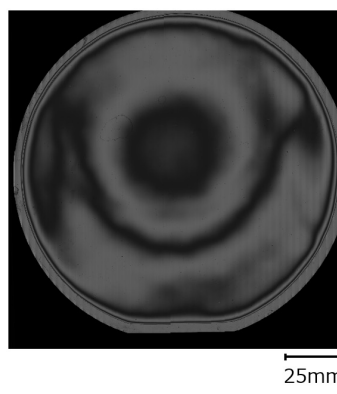


高分解能FiDiCa[®]装置外観

測定例



局所測定例 (シリコン上のTEOS膜)
左: 単一波長画像 右: TEOS膜の膜厚分布



全面測定例 (6インチウエハシリコン上のSiO₂膜)
左: 単一波長画像 右: SiO₂膜の膜厚分布



JFE テクノリサーチ 株式会社

<https://www.jfe-tec.co.jp>

0120-643-777

Copyright ©2023 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。